#### IKA/xxxx/LSIH No Bagian LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI **INSTRUKSI KERJA ALAT** Terbitan/Revisi 1/0 **Tanggal Terbit** 19 Oktober 2020 STANDAR OPERASI FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON Halaman 1 dari 6 **MICROSCOPE** (FESEM) Disetujui **Deputi Divisi Micro** & Nano Imaging

#### I. Data Teknis Alat

Merk : FEI

Tipe : Quanta FEG 650

Tahun pembelian : 2018

**Model** : Floor stand machine

Tipe sumber elektron: Schottky FEG (Field Emission Gun)

Detektor :

- ETD (Everhardt Thornley Detector) SEI untuk mode High-vacuum
- LFD (Large Field Detector) SEI untuk mode Low-vacuum
- GSED (Gaseous Secondary Electron Detector) SEI untuk mode ESEM
- vCD (very low voltage high contrast detector) BSE-image
- EDS (*Energy Dispersive Spectroscopy*) untuk mapping unsur dalam microanalysis
- Detektor STEM II untuk mode wetSTEM.

Fitur :

- Resolusi hingga ~1 nm
- Multi stub-stage hingga 16 buah stub diameter 12 mm
- Single stub-stage (high and low) untuk pengamatan dengan sistem rotasi dan tilting stage hingga 70°.
- Mode operasi High-vacuum untuk sampel material konduktif
- Mode operasi Low-vacuum dan ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) untuk sampel material non-konduktif dan sampel biologis
- Mode operasi wetSTEM untuk sampel biologis atau material berupa lembaran tipis (~ 150 nm) dengan mode gambar BF/DF atau BF/DF/HAADF dan holder sampel 3 mm TEM grid 100 mesh.
- Peltier stage untuk pengaturan suhu cold stage
- Holder berbentuk well (conical, flat shallow, and flat depth) untuk sampel berupa cairan

**Peralatan pendukung**: Generator set; UPS; Chiller; Kompresor

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	

LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI	No Bagian	:	IKA/xxxx/LSIH
INSTRUKSI KERJA ALAT	Terbitan/Revisi	:	1/0
STANDAR OPERASI	Tanggal Terbit	:	19 Oktober 2020
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE	Halaman	:	2 dari 6
(FESEM)	Disetujui	:	Deputi Divisi Micro & Nano Imaging



Foto Alat FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscope)

# II. Operasional Alat

### Catatan:

- a. Dokumen ini hanya berisi operasi standar FESEM mode *High vacuum* dan *Low vacuum* untuk akun "supervisor" (operator dan deputi).
- b. Mesin maupun komputer disimpan dalam kondisi *standby* setiap selesai penggunaan alat. Hanya monitor komputer mikroskop (MPC) dan monitor komputer EDS (EDS PC) yang dimatikan. Serta katup tabung gas Nitrogen disimpan dalam kondisi tertutup.

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	

LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI	No Bagian	:	IKA/xxxx/LSIH
INSTRUKSI KERJA ALAT	Terbitan/Revisi	:	1/0
STANDAR OPERASI	Tanggal Terbit	:	19 Oktober 2020
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE	Halaman	:	3 dari 6
(FESEM)	Disetujui	:	Deputi Divisi Micro & Nano Imaging

## A. Inisiasi Komunikasi Komputer

- 1. Hidupkan monitor MPC dan EDS PC dengan menekan tombol power di ujung kanan bawah masing-masing monitor.
- 2. Klik tombol Show UI pada monitor MPC
- 3. Masukkan *username* dan *password* pada jendela pop-up lalu klik OK atau tekan tombol enter pada keyboard

#### B. Menyiapkan Alat untuk Mulai Dioperasikan

- 1. Buka katup tabung gas Nitrogen (putar berlawanan arah jarum jam).
- 2. Klik tombol "Vent" pada interface software xTmicroscope di monitor MPC untuk membuka *chamber* FESEM. Pastikan tekanan gas output pada meter regulator maks 0.2 bar.
- 3. Tempatkan stub alumunium yang telah ditempel dengan spesimen yang akan diamati
- 4. Buka kamera navcam dan tekan tombol *shutter* setelah komunikasi kamera dengan komputer berhasil (tampilan default live navcam berada di kuadran 3 pada monitor MPC)
- 5. Tutup kembali kamera navcam setelah lampu mati
- 6. Tutup *chamber* FESEM
- 7. Pilih mode vakum. Atur terlebih dahulu tekanan yang ingin dicapai jika memilih mode *Low vacuum*.
- 8. Klik tombol "Pump" pada interface software xTmicroscope pada menu navigasi "Beam Control" di monitor MPC untuk memulai proses vakum *chamber* FESEM.

## C. Akuisisi Image

- 1. Setelah icon indikator vakum berwarna hijau (pojok kanan bawah monitor MPC) pilih HV dan spot yang diinginkan lalu klik tombol "Beam on"
- 2. Pilih kuadran untuk mengaktifkan tampilan live detektor (default kuadran 1)
- 3. Pilih titik pada spesimen yang diinginkan

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	

LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI	No Bagian	:	IKA/xxxx/LSIH
INSTRUKSI KERJA ALAT	Terbitan/Revisi	:	1/0
STANDAR OPERASI	Tanggal Terbit	:	19 Oktober 2020
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (FESEM)	Halaman	:	4 dari 6
	Disetujui	:	Deputi Divisi Micro & Nano Imaging

- 4. Atur "Brightness and Contrast". Pilih icon "Auto Brightness Contrast" untuk proses pengaturan otomatis atau tekan tombol F9. Putar knob "Brightness" dan "Contrast" pada MUI untuk pengaturan secara manual.
- 5. Klik icon "Reduced Area" pada icon bar untuk mengaktifkan tampilan area kecil pada proses pengaturan fokus gambar
- 6. Atur fokus gambar dengan cara memutar knob "Focus" pada MUI (coarse atau fine sesuai kebutuhan) atau klik-drag tombol kanan mouse komputer MPC lalu gerakkan ke kanan-kiri (dengan cara ini tampilan anak panah mouse akan menjadi ⇔).
- 7. Atur *stigmator* gambar dengan cara memutar knob "stigmator" pada MUI (X atau Y sesuai kebutuhan) atau tekan tombol "shift" pada *keyboard* dan klik-drag tombol kanan mouse komputer MPC lalu gerakkan ke kanan-kiri untuk stigmator sumbu X dan gerakkan ke depan-belakang untuk stigmator sumbu Y.
- 8. Klik icon "Link to Z" untuk mensinkronkan jarak pengamatan (WD)
- 9. Lakukan pengaturan fokus pada berbagai macam perbesaran. Ubah perbesaran gambar dengan memutar knob "Magnification" pada MUI atau tekan tombol "+" / "-" pada keyboard.
- 10. Pastikan nilai WD pada data bar gambar bernilai sama dengan nilai Z pada tampilan menu navigasi. Klik icon "Link to Z" kembali jika terjadi perbedaan nilai.
- 11. Lakukan modulasi lensa (wobble) jika diperlukan dengan cara klik icon "lens allignment". Selanjutnya atur posisi X dan Y lensa dengan klik-drag tombol kiri mouse MPC maupun posisi X dan Y dari fisik aperture.
- 12. Periksa pula "beam centering" dengan klik icon "direct adjustment" lalu klik tombol "crossover". Lakukan pengaturan sesuai rekomendasi (modulasi lensa dan atau modulasi stigmator)
- 13. Lakukan pengaturan fokus dan stigmator sekali lagi pada perbesaran yang diinginkan

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	

LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI	No Bagian	:	IKA/xxxx/LSIH
INSTRUKSI KERJA ALAT	Terbitan/Revisi	••	1/0
STANDAR OPERASI	Tanggal Terbit		19 Oktober 2020
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (FESEM)	Halaman	:	5 dari 6
	Disetujui	:	Deputi Divisi Micro & Nano Imaging

- 14. Optimalkan pengaturan "Brightness dan Contrast" baik secara otomatis maupun manual menggunakan videoscope dengan menekan tombol F3 pada keyboard
- 15. Setelah yakin mendapat gambar terbaik, atur "dwell time" ke nilai yang lebih tinggi untuk mendapat gambar minim noise (default dwell time pada proses pengaturan fokus adalah 300 ns atau 1 us) atau dengan menekan tombol preset F2 pada keyboard.
- 16. Pause tampilan *scanning* dengan klik icon pause/unpause atau tekan tombol F6 pada keyboard.
- 17. Simpan gambar dengan cara klik menu File dan pilih Save atau Save as
- 18. Default Save as type penyimpanan gambar adalah "TIF 8bit Grayscale Image Files (\*.tif)" dengan pilihan "Save image with Databar" tercentang.
- 19. Catat parameter akuisisi image pada "Lembar Kondisi Pengukuran FE-SEM"

#### D. Pengkondisian Alat setelah Akuisisi Image

- 1. Setelah selesai melakukan akuisisi data, matikan beam dengan cara klik tombol "Beam On" pada submenu "Beam controll"
- 2. Turunkan perbesaran ke angka 100X atau lebih kecil
- 3. Posisikan stigmator dan Beam shift ke nilai nol dengan cara klik kanan pada submenu tersebut dan pilih zero.
- 4. Turunkan stage dibawah garis penanda 10 mm dengan cara memasukkan nilai Z pada submenu Navigation dan tekan enter (Selalu siapkan jari kiri pada tombol esc pada keyboard untuk membatalkan perintah) atau aktifkan kuadran CCD (default kuadran 4) lalu klik-drag dan tarik ke bawah tombol scroll pada mouse MPC

### E. Pengkondisian Komputer dan Alat setelah Operasi

- 1. Keluarkan spesimen dari *chamber* dengan klik icon "Vent"
- 2. Setelah stub dikeluarkan, blow seluruh bagian *chamber* menggunakan blower lensa yang tersedia. Selanjutnya bersihkan *chamber* menggunakan tissue lintfree yang dibasahi dengan alkohol atau aseton. Pastikan tidak ada kotoran

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	

LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI	No Bagian	:	IKA/xxxx/LSIH
INSTRUKSI KERJA ALAT	Terbitan/Revisi	••	1/0
STANDAR OPERASI	Tanggal Terbit	••	19 Oktober 2020
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (FESEM)	Halaman	:	6 dari 6
	Disetujui	:	Deputi Divisi Micro & Nano Imaging

maupun cairan yang tersisa di dalam *chamber*. Lalu tutup kembali *chamber* FESEM.

- 3. Pilih opsi "High vacuum" lalu klik icon "Pump"
- 4. Setelah icon indikator vakum berwarna hijau (pojok kanan bawah monitor MPC) pilih menu File lalu pilih "Log off supervisor"
- 5. Tutup kembali katup tabung gas Nitrogen (putar searah jarum jam)
- 6. Matikan monitor MPC dan monitor EDS-PC.

	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Nike F. Khusnah, M. Si.	Prof. DrIng. Setyawan P. Sakti, M. Eng.	Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si.
Tanda tangan			
Tanggal			
		Status :	